61

Int. Cl.:

G 01 b, 11/14

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

X3



Als Erfinder benannt:

Deutsche Kl.:

Anmeldetag:

42 b, 26/03

42 b, 12/02

ve dene gentum

•	
Offenlegungsschrift	つりんこう ひょう
litton Lagungeechriff	/U74U1/
Onemegungssching	
	•

Aktenzeichen:

P 20 53 017.0

2

29. Oktober 1970

. (3)

1

(I) (II)

21)

Offenlegungstag: 4. Mai 1972

	Ausstellungspriorität:	_	
39	Unionspriorität	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ing the state of t
Ø	Datum:	_	100 % &
<u>3</u>	Land:		Tark to the second of the sec
3)	Aktenzeichen:	_	. •
<u> </u>	Bezeichnung:	Verfahren zur berührungslosen Abstandsmessung	
	+ 4		
⑥	Zusatż zu:	·	
@	Ausscheidung aus:		
0	Anmelder:	Grundig E. M. V. Elektro-l 8510 Fürth	Mechanische Versuchsanstalt Max Grundig,
	Vertreter gem. § 16 PatG:	.—	

Faith, Siegfried, Dipl.-Phys., 8510 Fürth;

Bauer, Dieter, Dipl.-Phys., 8520 Erlangen

GRUNDIG E.M.V. Fürth,23.10.1970
Elektro-Mechanische Versuchsanstalt 785-Vt, pa
Max Grundig
8510 Fürth/Bayern, Kurgartenstr. 37 Reg. 1545

Verfahren zur berührungslosen Abstandsmessung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur berührungslosen Abstandsmessung.

Es ist bereits ein Verfahren zur berührungslosen Abstandsmessung bekannt geworden, bei dem ein Lichtbündel auf die bezüglich ihres Abstandes vom Gerät zu messende Fläche gerichtet und die Strahlung, die von der dort entstehenden Lichtmarke reflektiert wird, teilweise durch eine Linse auf eine Anordnung von zwei Fotodioden gerichtet wird. Befindet sich die Meßfläche in einem bestimmten Abstand vom Gerät, dann erhält jede Fotodiode genau die gleiche Menge reflektierten Lichts. Bei einer Abstandsänderung der Meßfläche wird die Lichtverteilung dagegen zunehmend unsymmetrischer. Mit einer geeigneten Schaltung läßt sich über diese ungleichmäßige Lichtverteilung die Größe der Abstandsänderung ermitteln. Wegen der Abhängigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit des Meßobjekts und von der Intensität der Strahlung sowie von der Temperatur der Fotodetektoren ist das bekannte Meßverfahren nicht sehr genau.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein oberflächen-, intensitäts- und temperaturunabhängiges
Verfahren der berührungslosen Abstandsmessung zu
schaffen, mit dem innerhalb eines vorgegebenen Bereichs Abstände auch zu einer diffus reflektierenden Fläche mit großer Genauigkeit gemessen werden
können.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß die sich beim Lichtschnittverfahren aus einer Abstandsänderung zwischen Bezugspunkt und Meßobjekt ergebende Verschiebung eines über einen einstellbaren Spiegel auf einem ortsempfindlichen Fotoempfänger abgebildeten Spaltbildes durch eine Verstellung des Spiegels kompensiert und die zur Kompensation erforderliche Spiegelverstellung als Maß für die zu messende Abstandsänderung verwendet wird.

Die Erfindung soll nachstehend unter Bezugnahme auf ein in der Zeichnung dargestelltes Ausführungsbeispiel näher erläutert werden. Es zeigen:

- Fig. 1 eine Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens und
- Fig. 2 ein Blockschaltbild des elektrischen Teils der Vorrichtung.

Von einer Lampe 1 gelangt ein Lichtbündel über einen Kondensor 2, einen Spalt 3, einen Spiegel 4 und eine schlitzförmige Aperturblende 5 zu einem Objetiv 6 und wird auf dem Meßobjekt 8 abgebildet. Das von der Meßfläche reflektierte oder gestreute Licht gelangt zum Teil wieder in das Objektiv 6 und wird über eine zweite schlitzförmige Aperturblende 5', einen festen Spiegel 9, 10 und einen drehbaren Galvanometerspiegel 12 auf zwei Meßfotoelementen 13 abgebildet. Befindet sich die Meßfläche 8 gemuin der Bezugsebene, dann liegt das empfangsseitige sekundäre Spaltbild 14 in der Mitte der beiden Fotoelemente. Verändert sich der Abstand der Meßfläche zum Gerät, so wandert das sekundäre Spaltbild 14 seitlich über die Fotoelemente 13. Durch das Spiegelgalvanometer 12 wird jeweils ein Strom in solcher Stärke geschickt, daß die Spiegelverkippung das sekundäre Spaltbild 14 wieder in die Mitte der Fotoelemente 13 bringt. Der Strom durch das Galvanometer ist der Spiegelverkippung proportional und damit auch ein Maß für die Entfernung der Meßfläche 8 von der Bezugsebene.

Vor dem Galvanometerspiegel 12 kann ein Teil des Lichts von einem teildurchlässigen Spiegel 11 (z.B. 10 % Reflexion) abgetrennt und über den Spiegel 15 ein weiteres Spaltbild auf eine Anordnung von drei Fotoelementen 16 geworfen werden. Diese Fotoelemente bestimmen den Meßbereich in der Weise, daß das Spaltbild überwiegend auf dem mittleren Fotoelement liegen muß, wenn eine Messung erfolgen soll.

Die Meßfotoelemente 13 sind antiparallel geschaltet, so daß sie gemeinsam eine positive oder negative

Spannung abgeben, je nachdem welches der beiden Elemente stärker beleuchtet wird. Liegt das Spaltbild in der Mitte, so ist die Spannung Null. Ein Gleichspannungsverstärker 17 mit möglichst geringem Nullpunktfehler gibt die verstärkte Fotospannung auf ein Integrationsglied 18. Der Ausgang des Integrationsglieds 18 wird über einen hohen Vorwiderstand an das Spiegelgalvanometer 12 geführt, Damit ist der Strom durch das Galvanometer der Ausgangsspannung des Integrationsglieds 18 proportional; diese Spannung kann deshalb an den Neßausgang gegeben werden. Das Inte-

1918年1月1日

grationsglied 18 läßt den Strom durch das Spiegelgalvanometer 12 so lang anwachsen, bis die Spannung
an den antiparallel geschalteten Fotoelementen zu
Null geworden ist, d.h. das Spaltbild in der Mitte
der Elemente liegt. Bei dieser Nachführung ist die
Endstellung des Spiegels 12 und damit der Meßwert
nicht von der Intensität des Spaltbildes abhängig.

Zur Meßbereichserkennung dienen die drei Bereichsfotoelemente 16; sie sind so zusammengeschaltet,
daß eine positive Spannung entsteht, wenn auf das
mittlere Element mehr Licht fällt als auf die beiden
äußeren, dagegen eine negative Spannung, wenn auf
ein äußeres mehr Licht auftrifft. Diese Spannung
wird durch den Gleichspannungsverstärker 19 verstärkt und mit dem Schmitt-Trigger 20 über einen
Schalter 21 das Galvanometer eingeschaltet. Dadurch
werden unkontrollierte Bewegungen des Spiegels verhindert, wenn sich kein Meßobjekt im Meßbereich des
Gerätes befindet.

Patentansprüche:

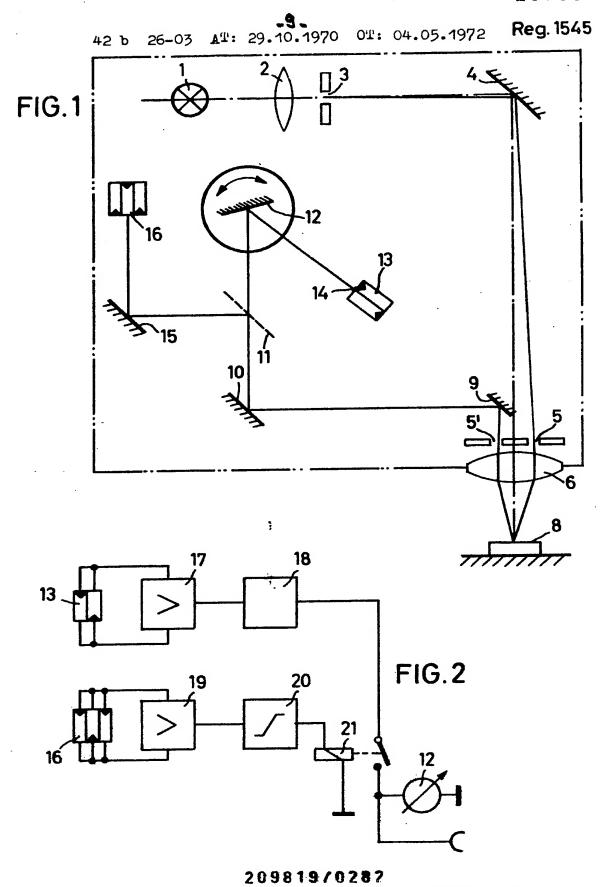
Patentansprüche

- Verfahren zur berührungslosen Abstandsmessung, dadurch gekennzeichnet, daß die sich beim Lichtschnittverfahren aus einer Abstandsänderung zwischen Bezugspunkt und Meßobjekt (8) ergebende Verschiebung eines über einen einstellbaren Spiegel (12) auf einem ortsempfindlichen Fotoempfänger abgebildeten Spaltbildes (14) durch eine Verstellung des Spiegels (12) kompensiert und die zur Kompensation erforderliche Spiegelverstellung als Maß für die zu messende Abstandsänderung verwendet wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Spaltbild (14) auf zwei antiparallel geschalteten Fotoelementen (13) abgebildet wird.
- 3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem einstellbaren Spiegel (12) mit Hilfe eines teiltransparenten Spiegels (11) ein Teil des Lichtstrahls abgezweigt und einer aus drei Fotoelementen (16) alternierender Polarität aufgebauten Einheit zur Meßbereichsbestimmung zugeführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Galvanometerspiegel (12) elektrisch eingestellt wird.

Le<u>e</u>rseite

CASTALON STATES



ORIGINAL INSPECTED